МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2024/2025 навчальний рік, прийому студентів 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

_____ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
"___"_____ 2024 р.

Спеціальність	161 Хімічні технології та інженерія	Факультет/ННІ	Хіміко-технологічний факультет
Освітня програма	Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення	Форма здобуття вищої освіти	*Очна (денна)*
Освітній ступінь	магістра	Строк навчання	1 рік 4 місяці
Випускова кафедра	*Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології*	Кваліфікація	Магістр з хімічних технологій та інженерії

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години								СРС	Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами							
								Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор													1 курс							
																									ХН-41мп (Б: 20, К: 0);							
																									1 семестр				2 семестр			
																									18 тижнів				18 тижнів			
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	Інд. зан.		Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	Всього	у т.ч.			Всього	у т.ч.		
																									Лекц	Практ	Лаб		Лекц	Практ	Лаб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																															
Цикл загальної підготовки																															
1	*Інтелектуальна власність та патентознавство (модуль Право інтелектуальної власності)*	КІВПП	20	0	1.0	30	18	12	-	6	-	-	-	0	12									1	0.67	0.33					
2	*Інтелектуальна власність та патентознавство (модуль Патентознавство та набуття прав)*	КМ	20	0	2.0	60	36	24	-	12	-	-	-	0	24		1	1						2	1.33	0.67					
3	*Маркетинг хімічної продукції*	ЕіП	20	0	3.0	90	54	18	-	36	-	-	-	0	36		1	1						3	1	2					
4	*Основи інженерії та технології сталого розвитку*	ШІ	20	0	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24		2	2										2	1	1	
5	*Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації*	АМТС1	20	0	3	90	72	-	-	72	-	-	-	0	18		2	1						2		2		2		2	
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					11	330	216	72	0	144	0	0	0	0	114	0	4	4	0	0	0	0	0	8	3	5	0	4	1	3	0
Цикл професійної підготовки																															
6	*Інноваційні хімічні технології створення новітніх матеріалів*	ТНРВ та ЗХТ	20	0	5.0	150	72	18	-	18	-	36	-	0	78	1		1				1		4	1	1	2				
7	*Інноваційні хімічні технології створення новітніх матеріалів. Курсова робота*	ТНРВ та ЗХТ	20	0	1.0	30	0	-	-	-	-	-	-	0	30		2		2												
8	*Моніторинг повітряного та техногенного середовища*	ТЕХВ	20	0	5.0	150	72	18	-	-	-	54	-	0	78	1		1				1		4	1		3				
9	*Ресурсозберігаючі та екологічно безпечні технології*	ТЕХВ	20	0	4.0	120	54	18	-	-	-	36	-	0	66		1	1						3	1		2				
10	*Сучасні методи водопідготовки та водоочищення*	ТНРВ та ЗХТ	20	0	5.0	150	72	18	-	-	-	54	-	0	78	1		1				1		4	1		3				
11	*Практична діяльність за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи практичної діяльності*	ТНРВ та ЗХТ	20	0	4.0	120	54	18	-	36	-	-	-	0	66		1	1						3	1	2					
12	*Практична діяльність за темою магістерської дисертації. Частина 2. Дослідницька робота за темою магістерської дисертації*	ТНРВ та ЗХТ	20	0	4.0	120	54	-	-	-	-	54	-	0	66		2											3			3
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					28	840	378	90	0	54	0	234	0	0	462	3	4	5	1	0	0	3	0	18	5	3	10	3	0	0	3
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					39	1170	594	162	0	198	0	234	0	0	576	3	8	9	1	0	0	3	0	26	8	8	10	7	1	3	3
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																															
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																															
13	*Сучасний інструментальний аналіз неорганічних речовин*	ТНРВ та ЗХТ	20	0	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	2		2				2						4	2		2
14	*Новітні системи генерування енергії*	ТЕХВ	0	0	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	2		2				2						4	2		2
15	*Світові тенденції очищення стічних вод*	ТНРВ та ЗХТ	20	0	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	2		2				2						4	2		2
16	*Сучасні технології функціональної обробки поверхні*	ТЕХВ	0	0	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	2		2				2						4	2		2
17	*Новітні хімічні технології одержання адсорбентів-каталізаторів*	ТНРВ та ЗХТ	20	0	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	2		2				2						4	2		2
18	*Інноваційні методи досліджень в хімічних технологіях та біоінженерії*	ТЕХВ	0	0	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	2		2				2						4	2		2
19	*Хімічні та електрохімічні методи в матеріалознавстві мікро- і нанорозмірних об'єктів*	ТЕХВ	0	0	4.0	120	54	18	-	36	-	-	-	0	66		2	2				2						3	1	2	
20	*Інноваційні хімічні технології переробки вторинних матеріалів*	ТНРВ та ЗХТ	20	0	4.0	120	54	18	-	36	-	-	-	0	66		2	2				2						3	1	2	
21	*Сучасні мембранні технології*	ТНРВ та ЗХТ	20	0	4.0	120	54	18	-	-	-	36	-	0	66		2	2				2						3	1		2
22	*Кінетика електродних процесів*	ТЕХВ	0	0	4.0	120	54	18	-	-	-	36	-	0	66		2	2				2						3	1		2
Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки					23	690	324	144	0	36	0	144	0	0	366	3	2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	18	8	2	8
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					23	690	324	144	0	36	0	144	0	0	366	3	2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	18	8	2	8
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					62	1860	918	306	0	234	0	378	0	0	942	6	10	14	1	0	0	8	0	26	8	8	10	25	9	5	11

Кількість	Кількість екзаменів	6				3				3			
	Кількість заліків	10					4				6		
	МКР	14						8				6	
	Курсових робіт	1											1
	Курсових проєктів	0											
	РГР, РР, ГР	0											
	ДКР	8						3				5	
	Рефератів	0											

Ухвалено на засіданні Вченої ради ХТФ ПРОТОКОЛ № 5 від 2024-06-03

Завідувач кафедри ТНРВ та ЗХТ _____ Тетяна ДОНЦОВА
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) _____ Ольга ЛІНЮЧЕВА
(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;